Ein neues System zur automatischen Messung von Kristallorientierungen (ACOM)

Robert Schwarzer

Kappstr. 65, D-71083 Herrenberg

Email: schwarzer@tu-clausthal.de

Überblick

Motivation für die off-line Auswertung Messung: Hardware *NORDIF 500UF* Indizierung: Software *SEMdif Viewer* Anwendungsbeispiel

Motivation für die off-line Auswertung

- Off-line Auswertung ist bei EDS längst üblich.
- Auswertung ist beliebig wiederholbar:
 - + Höhere Sicherheit
 - + Optimierung der Parameter des Auswerteprogramms
 - + Test auf a priori nicht bekannte Phasen
- Hohe Messgeschwindigkeit ist wirtschaftlich:
 - + REM wird nicht blockiert
 - + Die geringe Stabilität von kalten FE-Quellen wird aufgefangen.
 - + Dynamische in-situ Untersuchungen
- (• Räumliche Entfernung der Arbeitsgruppen, die das System entwickeln (Norwegen Deutschland))

Motivation für die off-line Auswertung

- konstante Integrationszeit pro Diagramm (typisch <2 ms)
 - + Keine Synchronisationsprobleme zwischen Aufnahme und Auswertung
 - + Messung muss nicht auf die *orientierungsabhängige* und *phasenabhängige* Auswertung warten.
 - + Kamera arbeitet optimal im "Videomodus", keine Geschwindigkeitseinbusse wie im Fall der Kamerainitialisierung von Bild zu Bild.
 - + Exakte Zuordnung von Diagramm zu Messort. Frei laufende, unsynchronisierte Kamera führt zumindest an Korngrenzen zu Fehlern.

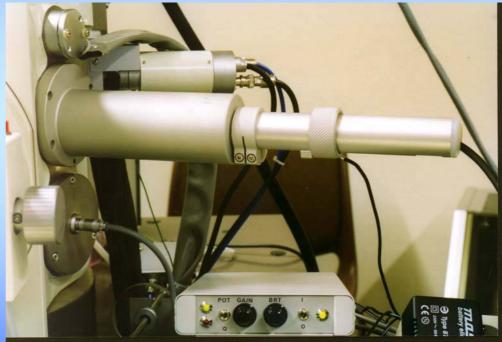
Messung: Hardware NORDIF 500UF *)

- Digitale Strahlrasterung mit 16 bit
- Hochempfindliche, schnelle Kamera
- Pixel-Binning auf dem Sensorchip
- Datenübertragung im GigE-Vision-Standard
 - + hohe Geschwindigkeit
 - + großer Abstand zwischen REM und Rechner
 - + einfache Programmierung
 - + standardkonforme Kameras direkt austauschbar (laufende Verbesserungen der Industriekameras, zukunftssicher, niedrige Kosten)
 - + preiswerte Ethernetkarte statt Framegrabber
- *) Prof. Jarle Hjelen, NTU Trondheim (Norwegen)

Messung: Hardware NORDIF 500UF

• Die selbe Gehäusedimension wie die den bisherigen Nordif-Detektoren (und früheren HKL-Detektoren)





Jeol JSM 840

Messung: Hardware NORDIF 500UF



Jeol JSM 6700-1

Zeiss Gemini 1530



Indizierung: Software SEMdif Viewer

- Die Diagramme werden im *Rohformat* nach 4x4 Binning gespeichert und ausgewertet, d.h. keine bereits reduzierten Daten (wie eventuell verfälschende "Hough-Peaks")
- Dynamische Untergrundkorrektur mittels Software; DSP nicht erforderlich
- Alternativ Untergrundkorrektur mit Leerbildern
- Semi-automatische Setup-Kalibrierung
- Dynamische Kalibrierung von Punkt zu Punkt (korrigiert Arbeitsabstand und unbemerkte Verdrehung um die Mikroskop-(z-)Achse)

Indizierung: Software SEMdif Viewer

- Radon-Transformation mit Analyse der Bandprofile statt der problematischen ,,modified Hough transform with butterfly mask" und "back-projection"
- Laufende Wiedergabe des Orientierungsverteilungsbildes (COM), Pattern Quality Maps, Indexing Quality Maps, der Pattern Sequence, der Untergrundkorrektur, des Radon-Raums

Systemleistung

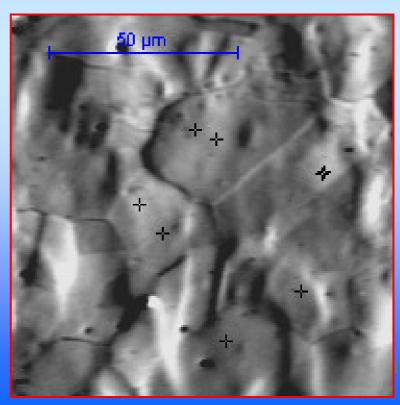
- Diagrammerfassung: ≥ 500 Diagramme/sec
 (Al, Ni; 20 kV, <≈ 20 nA)
- Off-line Auswertung: vollautomatisch mit ca. 100 Orientierungen/sec, PQ, IQ (keine Kompromisse bezüglich der Anzahl der zu indizierenden Bänder)
- Diagramme und Daten bleiben einander zugeordnet.
- Die weitere Auswertung (Filtern, KG, Σ-KG, Orientierungsstereologie) erfolgt mit separatem Programm (SigmaCom).

Anwendungsbeispiel

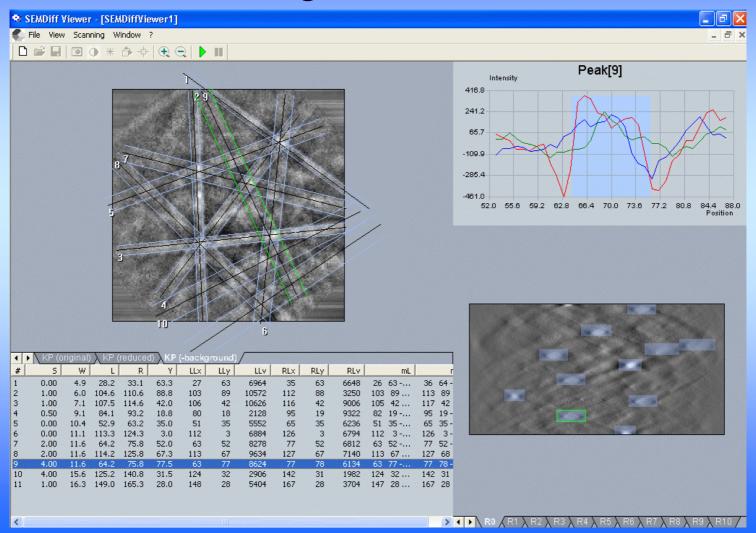
In-situ Rekristallisationsuntersuchungen an Nickel erfordern hohe Messgeschwindigkeit

- Sehr hoher Probenstrom bei Heizversuchen zulässig (bis ≈ 50 nA (FE SEM) bei 20 kV)
- Kleines Rasterfeld von 100 x 100 Punkten
- Schrittweite (1 μm) an die Korngröße anpassen
- Kurze Integrationszeit 1,28 msec/Diagramm
 - $\rightarrow t \approx 15 \text{ sec}$ >750 Diagramme/sec

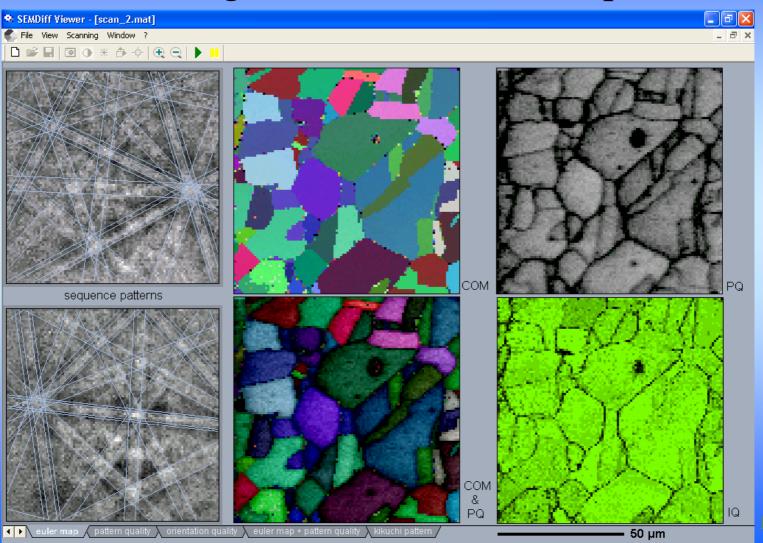
Messfeld 100 x 100 μm² SE-Bild



Anwendungsbeispiel Ein Kalibrierdiagramm und Radon-Raum



Anwendungsbeispiel Verteilungsbilder einer Messsequenz



Besuchen Sie doch mal meine Webseiten

www.ebsd.info www.ebsd.de www.crystaltexture.com

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.